2023年度 大阪大学 ARIM オンラインセミナー

微細加工・電子ビーム露光技術

～電子線描画におけるスループット向上のためのテクニック～

大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点（ARIM）は、令和3年度からスタートした文部科学省委託事業である「マテリアル先端リサーチインフラ事業」の一環として、オンラインによる技術セミナー『微細加工・電子ビーム露光技術』を2024年1月19日（金）に開催いたします。
レーザー描画、電子ビーム描画、機械加工プロセスを用いた微細加工アプリケーション、スループットの観点から捉えた電子ビーム描画装置の選択と露光条件の検討についてご紹介いたします。
産学官いずれのご所属の方にも奮ってのご参加をお待ちしております。

◇講演
【日時】 2024年1月19日（金）10:00～11:30
【ウェビナー配信】 GoogleMEETによるオンライン配信
（PCでご参加の場合Googleアカウントは必要ありません）
【参加費】 無料
【定員】 100名（先着順、参加登録をお願いします）
【お申込み】 https://forms.gle/JmysYtInI4bhgsJD6
【お申込み締め切り】2024年1月16日(火)

◇講演プログラム
10:00-10:05 はじめに
大阪大学　産業科学研究所　岡本 稔

10:05-10:35 『レーザー描画、電子ビーム描画、機械加工プロセスを用いた微細加工アプリケーションの御紹介』
Bush Clover株式会社　営業部　久保川 達矢

10:35-11:05 『電子線描画におけるスループット向上のためのテクニック』
Bush Clover株式会社　技術部　新関 嵩

11:05-11:25 『微細加工に関するお困り事相談』
＊ご参加者様より電子ビーム描画プロセスなど微細加工に関するご質問、課題について自由に御相談頂けます。
Bush Clover株式会社　技術部　新関 嵩

【主催】大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点（ARIM）
【共催】Bush Clover株式会社

お問い合わせ
大阪大学マテリアル先端リサーチインフラ設備供用拠点（ARIM）事務局
E-mail：info-nanoplat@sanken.osaka-u.ac.jp